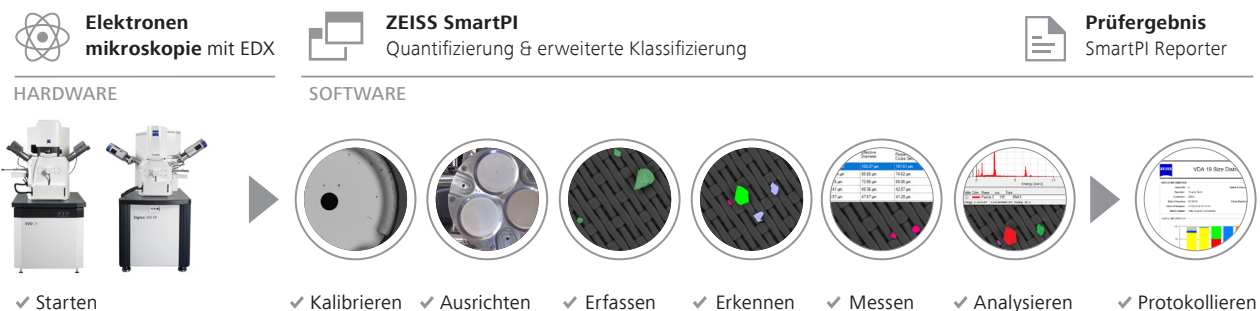


Identify the root cause. Make the right decision faster.

ZEISS SmartPI

Technische Sauberkeitslösung für die Elektronenmikroskopie

ZEISS SmartPI wurde für eine wiederholbare, hochauflösende Analyse von Routineproben in einer Produktionsumgebung entwickelt. Die Fähigkeit, Kontaminationsdaten zu identifizieren, zu analysieren und zu protokollieren, schafft eine neue Dimension der Prozesskontrolle. Machen Sie den nächsten Schritt in der Technischen Sauberkeit mit ZEISS SmartPI - jetzt auch mit der neuesten Generation von Oxford EDX-Detektoren. Profitieren Sie von signifikanten Verbesserungen bei der vollautomatischen REM-Partikelanalyse und -klassifizierung. Lassen Sie ZEISS SmartPI Ihre Produktivität steigern, Ihre Qualität erhöhen und Ihre Kontaminationskosten reduzieren.



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Leistungsstarke, vielseitige All-in-One-Anwendung zur Partikelanalyse für Ihre ZEISS EVO & ZEISS Sigma Familie.
- Eine Komplettlösung, die wiederholbare Probenanalysen vollständig automatisiert und objektive Ergebnisse liefert und das bei minimaler Benutzerinteraktion.
- Volle Bedienkontrolle über das REM, erweiterte Bildverarbeitung, Bildanalyse und Elementaranalyse (EDX) - alles gesteuert mit nur einer einzigen Anwendung.
- Automatische Erkennung, Messung, Quantifizierung und Klassifizierung der relevanten Partikel, basierend auf Morphologie und Elementzusammensetzung.
- Industriestandardberichte werden automatisch generiert, z.B. nach VDA 19.1 & ISO16232.
- Vollständig integrierte Einbindung und Kompatibilität mit Bruker & Oxford EDX-Systemen.
- Unterstützt die korrelative, automatisierte Partikelanalyse mit ZEISS Lichtmikroskopen.

Carl Zeiss
Industrielle Messtechnik GmbH
73446 Oberkochen/Germany

Tel: +49 7364 20-6337
Fax: +49 7364 20-3870
info.metrology.de@zeiss.com
www.zeiss.de/imt



Seeing beyond